

NUBIC 知的財産情報開示

開示日：2022年7月15日

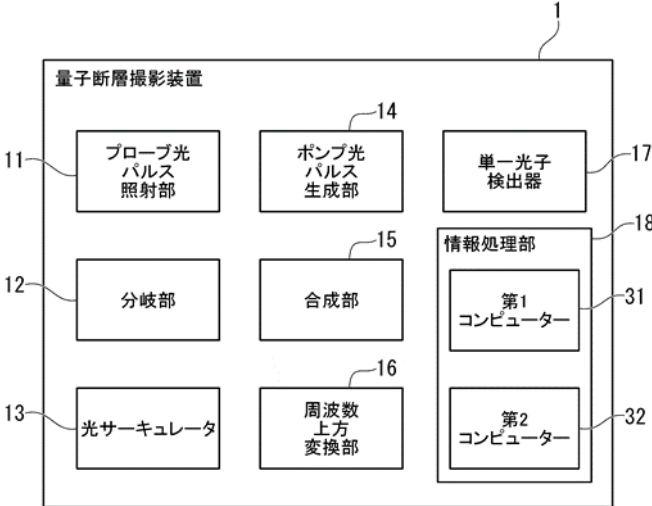
各 位

NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。

技術移転等を御希望の場合は、ホームページの「**NUBIC 技術シーズ案件申込**」フォームからお申込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。

「NUBIC 技術シーズ案件申込」フォーム：

TOP>共同・受託研究>申込書／契約書>本学研究シーズの利活用の申込み>WEB から

出願番号	2022-059587	整理番号	12411	担当者	日向 誠治
表題	量子断層撮影装置				
発明の概要・応用	<p>【課題】 画像化できる深さを拡張し、高いコントラスト（高いS/N比）の画像を得る。</p> <p>【解決手段】 量子パルスゲート特性を有する光学素子を用いて、生体試料における所望の深さの断層画像情報を取得する量子断層撮影装置であって、プローブ光パルスを2つの分岐プローブ光パルスに分岐し、一方の分岐プローブ光パルスを生体試料に照射してその反射光パルスを取得し、他方の分岐プローブ光パルスに遅延を与える遅延部および他方の分岐プローブ光パルスの波形整形を行う波形整形部を有し、遅延および波形整形が行われた結果をポンプ光パルスとして生成し、反射光パルスとポンプ光パルスとを合成して、これらの合成光パルスを生成し、合成光パルスを光学素子に入力して、光学素子が有する量子パルスゲート特性によって、合成光パルスに含まれる所望の信号光パルスの周波数を上方に変換した結果である上方変換後信号光パルスを単一光子検出器で検出する。</p>				
発明の特徴・効果	<p>量子断層撮影装置において、画像化できる深さを拡張し、高いコントラスト（高いS/N比）の画像を得ることができる。</p> 				
技術分野	電気・電子				



【問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp